® 日本国特許庁(JP) ⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平4-116557

Sint. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	③ 公開	平成4年(1992)4月17日
G 03 F 7/027 7/038	5 1 4 5 0 4 5 0 5	9019-2H 7124-2H 7124-2H		
H 01 L 21/027	505	/124—2H		
// G 02 F 1/1337	520	8806—2К 7352—4М Н (01 L 21/30	301 R
		審査請案	求 未請求 翻	青求項の数 1 (全6頁)

69発明の名称 感光性樹脂組成物のパターン形成方法

> 创特 顧 平2-235783

22出 顧 平2(1990)9月7日

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト @発 明 株式会社内

@発 明 耷, 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

@発 光 弘 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ペークライト 株式会社内

の出 原類 人 住友ペークライト株式 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

会社

1. 発明の名称

感光性樹脂組成物のパターン形成方法

2. 特許請求の範囲

(1)下記式〔Ⅰ〕で示されるポリアミド酸エステ IL

(式中、R::3又は4価の有機基、R2:2価の有機基、

あって、何じであっても違っていてもよい。

1,m,n:0 又は 1、 p:2~5の整数、

1 < x, y < 100, 0 < z < 90 m o x + y + z = 100ス, y, z:各構造単位の百分率)

を主成分とする皮膜にマスクを介し光を照射し、 これをアルカリ水溶液にて現像してレリーフパタ ーンを形成するパターン形成方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、高感度で、かつ公害問題が生じ難い、 アルカリ水溶液にて現像できる感光性樹脂組成物 のパターン形成方法に関するものである。

[従来の技術]

従来、半導体素子の表面保護膜、層間絶縁膜な どには、耐熱性が優れ、また卓越した電気絶縁性、 機械強度などを有するポリイミドが用いられてい るが、ポリイミドパターンを作成する繁雑な工程 を簡略化する為にポリイミド自身に感光性を付与 する技術が最近注目を集めている。

例えば、下式

で示されるような構造のエステル基で感光性基を 付与したポリイミド前駆体組成物(例えば特公昭 55-41422号公報)、あるいは下式

で示されるような構造のポリアミック酸に化学線 により2量化、または重合可能な炭素 - 炭素二重

カリ水溶液による現像を可能にするパターン形成 方法を提供するにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は、下記式(I)で示されるポリアミド 酸エステル

(式中、R1:3又は4価の有機基、R2:2価の有機基、

R4:3~6価の有機基、R5: H 又は CH3基 それぞれのR1,R2,R3,R4,R5はそれぞれが独立で あって、同じであっても違っていてもよい。

1,m,n:0 又は 1、 p:2~5の整数、

1 < x, y < 100, 0 < z < 80 $\Rightarrow x + y + z = 100$

結合およびアミノ基または、その四級化塩を含む 化合物を添加した組成物(例えば特開昭54-145794 号公報)などが知られている。

これらは、いずれも適当な有機溶剤に溶解し、 ワニス状態で塗布、乾燥した後、フォトマスクを 介して紫外線照射し、有機溶剤にて現像、リンス 処理して所望のパターンを得、さらに加熱処理す ることによりポリイミド被膜としている。

しかし、かかる従来の感光化技術において、アルカリ水溶液で現像しようとした場合、エステル基に感光基を導入した方法では全く現像することができない。またイオン結合的に感光基を導入した方法では、露光部と未露光部に溶解性の差がでず、全て溶出してしまい、アルカリ水溶液での現像は不可能であった。

[発明が解決しようとする課題]

本発明の目的とするところは、ポリアミド酸中の一部のカルボキシル基へ多官能のアクリル (メタクリル) 基を導入した樹脂組成物を用いることにより、高感度でかつ公害問題を生じ難い、アル

x,y,z:各構造単位の百分率)

を主成分とする皮膜にマスクを介し光を照射し、 これをアルカリ水溶液にて現像してレリーフパタ ーンを形成するパターン形成方法である。

[作用]

3',4'-ペンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、 ナフタレン-2,3,6,7-テトラカルポン酸二無水物、 ナフタレン-1,2,5,6-テトラカルポン酸二無水物、 ナフタレン-1.2.4.5-テトラカルボン酸二無水物、 ナフタレン-1.4.5,8-テトラカルポン酸二無水物、 ナフタレン-1,2,8,7-チトラカルボン酸二無水物、 4.8-ジメチル-1.2.3.5.8.7-ヘキサヒドロナフタ レン-1,2,5,6-テトラカルボン酸二無水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,8,7-ヘキサヒドロナフタレン-2,3,6,7-テトラカルボン酸二無水物、2,6-ジクロ ロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水 物、2.7-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テトラカ ルポン酸二無水物、2,3,6,7-テトラクロロナフタ レン-1,4,5,8-テトラカルポン酸二無水物、1,4,5. 8-テトラクロロナフタレン-2,3,6,7-テトラカル ポン酸二無水物、3,3',4,4'-ジフェニルテトラカ ルポン酸二無水物、2,2',3,3'-ジフェニルテトラ カルボン酸二無水物、2,3,3',4'-ジフェニルテト ラカルポン酸二無水物、3,311,4,411-p-テルフェ ニルテトラカルボン酸二無水物、2.2′′,3.3′′-p-

テルフェニルテトラカルボン酸二無水釉、2,3,3 ',4''-p-テルフェニルテトラカルボン酸二無水物、 2, 2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)-プロパン 二無水物、2,2-ピス(3,4-ジカルポキシフェニル)-プロパン二無水物、ビス(2.3-ジカルボキシフェ ニル)エーテル二無水物、ビス(3,4-ジカルポキシ フェニル)エーテル二無水物、ビス(2,3-ジカルボ キシフェニル)メタン二無水物、ビス(3,4-ジカル ポキシフェニル)メタンニ無水物、ピス(2,3-ジカ ルポキシフェニル)スルホン二無水物、ビス(3,4-ジカルポキシフェニル)スルホン二無水物、1.1-ビス(2.3-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、 1.1-ビス(3.4-ジカルボキシフェニル)エタン二無 水物、ペリレン-2,3,8,9-テトラカルボン酸二無 水物、ペリレン-3,4,9,10-テトラカルボン酸二無 水物、ペリレン-4,5,10,11-テトラカルポン酸二 無水物、ペリレン-5,6,11,12-テトラカルボン酸 二無水物、フェナンスレン-1,2,7,8-テトラカル ポン酸二無水物、フェナンスレン-1,2,6,7-テト ラカルボン酸二無水物、フェナンスレン-1,2,9,

10-テトラカルボン酸二無水物、シクロベンタン-1, 2,3,4-テトラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3, 5,6-テトラカルボン酸二無水物、ピロリジン-2,3, 4,5-テトラカルボン酸二無水物などがあげられるが、これらに限定されるものではない。また、使用にあたっては、1種類でも2種類以上の混合物でもかまわない。

本発明において用いるRzは、2 価の有機基で、通常芳香族ジアミン及び/又はその誘導体が使用される。例えばm-フェニレン-ジアミン、n-フェニレン-ジアミン、4.4'-ジアミノ-ジフェニルプロパン、4.4'-ジアミノ-ジフェニルエタン、3.3'-ジアミノ-ジフェニルメタン、3.3'-ジアミノ-ジフェニルメタン、3.3'-ジアミノ-ジフェニルメタン、4.4'-ジアミノ-ジフェニルスルフィド、3.3'-ジアミノ-ジフェニルスルフィド、4.4'-ジアミノ-ジフェニルスルフィド、4.4'-ジアミノ-ジフェニルスルカン、1.3'-ジアミノ-ジフェニルスルホン、

4,4'-ジアミノ-ジフェニルエーテル、3,3'-ジア ミノ-ジフェニルエーテル、ペンジジン、3,3'-ジ アミノ-ビフェニル、3,3′-ジメチル-4,4′-ジアミ ノ-ビフェニル、3.3′-ジメトキシ-ペンジジン、4. 4′′-ジアミノ-p-テルフェニル、3,3′′-ジアミノp-テルフェニル、ビス(p-アミノ-シクロヘキシル) メタン、ビス(p-β-アミノ-t-ブチルフェニル)エ ーテル、ビス(p-β-メチル-δ-アミノペンチル) ペンゼン、p-ビス(2-メチル-4-アミノ-ペンチル) ペンゼン、p-ビス(1,1-ジメチル-5-アミノ-ペン **チル)ペンゼン、1,5-ジアミノ-ナフタレン、2,6-**ジアミノ-ナフタレン、2,4-ピス(8-アミノ-t-ブ チル)トルエン、2,4-ジアミノ-トルエン、ローキシ $\nu \, \nu \, -2.5 - \vec{y} \, \vec{r} \, \vec{z} \, \nu \, \cdot \, p - \vec{r} \, \vec{v} \, \nu \, \nu \, -2.5 - \vec{y} \, \vec{r} \, \vec{z} \, \nu \, \cdot \, \nu$ a-キシリレン-ジアミン、p-キシリレン-ジアミン、 2.6-ジアミノ-ビリジン、2.5-ジアミノ-ビリジン、 2.5-ジアミノ-1.3.4-オキサジアゾール、1.4-ジ アミノ-シクロヘキサン、ピペラジン、メチレン-ジアミン、エチレン-ジアミン、プロピレン-ジア ミン、2.2-ジメチル-プロピレン-ジアミン、テト

ラメチレン-ジアミン、ペンタメチレン-ジアミン、 ヘキサメチレン-ジアミン、2,5-ジメチル-ヘキサ メチレン-ジアミン、3-メトキシ-ヘキサメチレン ジアミン、ヘブタメチレン-ジアミン、2,5-ジメ チル-ヘブタメチレン-ジアミン、3-メチル-ヘブ タメチレン-ジアミン、4.4-ジメチル-ヘブタメチ レン-ジアミン、オクタメチレン-ジアミン、ノナ メチレン-ジアミン、5-メチル-ノナメチレン-ジ アミン、2,5-ジメチル-ノナメチレン-ジアミン、 デカメチレン-ジアミン、1,10-ジアミノ-1,10-ジ メチル-デカン、2,11-ジアミノ-ドデカン、1,12-ジアミノ-オクタデカン、2.12-ジアミノ-オクタ デカン、2,17-ジアミノ-アイコサン、ジアミノシ ロキサン、2,6-ジアミノ-4-カルポキシリックベ ンゼン、3,3'-ジアミノ-4,4'-ジカルボキシリッ クペンジジンなどがあげられるが、これらに限定 されるものではない。また使用にあたっては、1 種類でも2種類以上の混合物でもかまわない。

本発明に使用する一般式 (I) 中、Roは、アクリル (メタクリル) 基を2~5基有する多官能な感

リスリトールトリアクリレート、トリメチロール プロパンジメタクリレート及びこれらの誘導体が あげられるが、これらに限定されない。これらの 使用にあたっては1種類でも2種類以上の混合物 でもかまわない。

本発明に使用する一般式(I)で示されるボリアミド酸エステルは、カルボキシル基に感光基が導入された構造単位の割合が x、カルボキシルボ 基単位の割合が y、カルボキシル 基が なんされた 関係されて 100 で 1

本発明におけるポリアミド酸エステル(I)は、 通常以下のようにして合成される。まず、アルコ 光性基である。アクリル(メタクリル)基が1基 では架橋密度が低く低感度のものしか得られず好 ましくない。また6基以上のアクリル(メタクリ ル)基は工業上製造が困難であるばかりでなく、 分子量が大きくなるため相溶性が低下し好ましく ない。Roを導入するための化合物としては、例え は、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペ ンタエリスリトールトリメタクリレート、ペンタ エリスリトールアクリレートジメタクリレート、 ペンタエリスリトールジアクリレートメタクリレ ート、ジベンタエリスリトールペンタアクリレー ト、ジベンタエリスリトールペンタメタクリレー ト、グリセロールジアクリレート、グリセロール ジメタクリレート、グリセロールアクリレートメ タクリレート、トリメチロールプロバンジアクリ レート、1,3-ジアクリロイルエチル-5-ヒドロキ シエチルイソシアヌレート、1,3-ジメタクリレー ト-5-ヒドロキシエチルイソシアヌレート、エチ レングリコール変性ペンタエリスリトールトリア クリレート、プロピレングリコール変性ペンタエ

ール基を有する多官能感光基Roを溶媒に溶解させ、これに過剰の酸無水物又はその誘導体を反応させる。この後、残存するカルボキシル基、酸無水物基に、ジアミンを反応させることにより合成することができる。即ち、Ro成分、酸無水物成分、ジアミン成分の反応モル比を制御することにより、カルボキシル基の感光基置換率を容易に制御することが可能である。

上記のポリアミド酸エステル(I)以外にも感光特性やその他の特性を向上させるために、各種光開始剤、増感剤、感光助剤、アクリル(メタクリル)オリゴマー、禁止剤、着色剤、光散乱防止剤、分散剤、充填剤、接着助剤、皮膜平滑剤、溶剤等を添加しても構わない。

本発明による感光性樹脂組成物の皮膜作成方法は、まず、該組成物を適当な支持体、例えばシリコンウェハーやセラミック、アルミ基板などに塗布する。塗布方法は、スピンナーを用いた回転塗布、スプレーコーターを用いた噴霧塗布、浸漬、

印刷、ロールコーティングなどで行なう。次に、60~80℃の低温でプリベークして塗膜を乾燥することによって得られる。次に、この皮膜に対し、所望のパターン形状に化学線を照射する。化学線としては、X線、電子線、紫外線、可視光線などが使用できるが、200~500ngの波長のものが好ましい。さらにこの化学線を照射した皮膜に対し、アルカリ水溶液で現像することによりレリーフバターンを得る。

ステル化した後、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル 170.2g(0.85モル)をジシクロヘキシルカルポジイミドを縮合剤として、ポリアミド酸エステル共重合物を得た。ジシクロヘキシルウレアを纏別後、エタノールに再沈し、固形物を濾過し、緩圧乾燥した。次に、このポリアミド酸エステル100重量部に、ミヒラーケトン(入 max 365nm) 5重量部及びメチルエーテルハイドロキノン0.1重量部をN.N-ジメチルアクリルアミド300重量部に溶解させ、感光性樹脂組成物を得た。

得られた溶液をアルミ板上にスピンナーで塗布 し、乾燥機により60℃で1時間乾燥した。

このフィルムにコダック社製フォトグラフィックステップタブレットNo2、21ステップ(本グレースケールでは、段数が一段増加するごとに透過光量が前段の1/√2に減少するので現像後の残存段階が大きいものほど感度が良い)を重ね、500mJ/cm²の紫外線を照射し、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド1%水溶液にて、1分間ディップ現 し、さらに純水でリンスをしたところ、

類の水溶液、及びこれにメタノール、エタノールのようなアルコール等の水溶性有機溶媒や界面活性剤を適当量添加した水溶液を好適に使用することができる。

現像方法としては、例えばスプレー、バドル、 浸漬、超音波などの方式が可能である。

次に、現像によって形成したレリーフパターンをリンスする。リンス液としては、例えば蒸留水を使用する。次に加熱処理を行ない、耐熱性に富む最終パターンを得る。

本発明による感光性樹脂組成物は、半導体用途のみならず、多層回路の層間絶縁膜やフレキシブル銀張板のカバーコート、ソルダーレジスト膜や液晶配向膜などとしても有用である。

以下実施例により本発明を具体的に説明する。 (実施例1)

ピロメリット酸二無水物 65.5g(0.30モル)と3, 3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水 物 225.5g(0.70モル)とを、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシブロパン 228g(1.00モル)でエ

14 段までバターンが残存し、高感度であることが 判った。また別途解像度評価用マスク(凸版印刷 開製)を用いて 200 u J/c m ² 照射し、同様に現像を 行った結果、4 μ m まで解像し、鮮明な レリーフパ ターンが得られることが判った。

(実施例2)

実施例 1 中、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロパンをペンタエリスリトールトリアクリレートに替えて樹脂組成物を得、実施例 1 と同様の評価を行った。その結果、ステップタブレット段数は 16段と高感度にアルカリ水溶液現像することができた。さらに解像度は 4 μ m と鮮明な レリーフパターンが得られた。

(実施例3)

実施例 1 中、N,N-ジメチルアクリルアミドをN-メチル-2-ピロリドンに替えて樹脂組成物を得、実施例 1 と同様の評価を行った。ステップタブレット段数は11段と高感度で、また解像度も5 μ m と 鲜明なレリーフパターンがアルカリ水溶液現像にて得られた。

特間平4-116557 (6)

(比較例1)

実施例 1 中、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロバンの反応量を 547.2g(2.4モル)として反応させ、その後同様の操作を行い、機器組成物を得、さらに同一の評価を行った。しかし10分後でも現像できず、実用性のないことが判った。 (比較例 2)

実施例 1 中、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロパンを 2-ヒドロキシエチルメタクリレートに替え、反応させ、樹脂組成物を得、さらに同様の評価を行った。 感度は 6段と低く、また解像度を評価しようとしたがレリーフパターンが崩れ正確な評価ができず、実用性のないことが判った。 [発明の効果]

従来、ポリアミド酸のカルボキシル基にエステル状に感光性基を導入する技術が知られていたが、かかる従来技術ではアルカリ現像することが不可能であった。しかし本発明では、ポリアミド酸の一部に多官能の感光基を導入することにより感度を低下させることなく、公客問題の生じ難いアル

カリ水溶液に良く溶解させることが可能となった。 このためアルカリ水溶液で現像することにより、 高感度で、かつ高解像度のレリーフバターンを安 全にかつ容易に得られる方法を見出すことができ た。

特許出願人 住友ペークライト株式会社